

377893-2026 - Wettbewerb

Schweiz – Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser) – Integrierter UHV-Cluster für gepulste Laserdeposition (PLD) und Sputterdeposition von Dünnschichten

OJ S 104/2026 02/06/2026

**Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Lieferleistungen**

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: ETH Zürich - Abt. Procurement & Export Services

E-Mail: publictender@ethz.ch

Rechtsform des Erwerbers: Einrichtung des öffentlichen Rechts

Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Bildung

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: Integrierter UHV-Cluster für gepulste Laserdeposition (PLD) und Sputterdeposition von Dünnschichten

Beschreibung: Das Laboratorium für Anorganische Chemie der ETH Zürich plant die Beschaffung eines integrierten UHV-Clusters für gepulste Laserdeposition (PLD) und Sputterdeposition von Heterostrukturen aus Oxid- und Metallschichten. Das System soll die Materialsynthese auf Oxidsubstraten mit einer Fläche von bis zu 10 x 10 mm² ermöglichen. Es soll aus einer PLD-Kammer, einer Sputterkammer, einer zentralen UHV-Transferkammer und einer Schleusenkammer für den Austausch von Proben und PLD-Targets bestehen, ohne die Prozesskammern zu belüften. Alle Kammern müssen Basisdrücke unter 1 x 10⁻⁷ mbar aufweisen. Die PLD-Kammer muss mit einem KrF-Excimerlaser und in-situ Hochdruck-RHEED ausgestattet sein und für routinemässiges epitaktisches Oxidwachstum bei hohen Temperaturen um 1100 °C geeignet sein. Die Sputterkammer muss DC- und RF-Magnetronspattern von Metall- und Oxidschichten ermöglichen, einschliesslich reaktivem Sputtern in Ar/O₂-Atmosphären, mit Substratheizung bis mindestens 700 °C unter Verwendung eines Probenträgersystems, das mit der PLD-Kammer kompatibel ist. Das System muss den Probentransfer zu einem externen UHV-Transferkoffer ermöglichen und UHV-kompatible Ports für die zukünftige Erweiterung des Clusters vorsehen. Für weitere Details siehe Spezifikationsdokument.

Kennung des Verfahrens: 13dcfc3d-4f30-4783-ab35-fef4567ee680

Verfahrensart: Offenes Verfahren

Das Verfahren wird beschleunigt: nein

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Lieferleistungen

Haupteinstufung (cpv): 38000000 Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)

2.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Zürich ETH Hönggerberg

Postleitzahl: 8093

Land, Gliederung (NUTS): Zürich (CH040)

Land: Schweiz

2.1.4. Allgemeine Informationen

Zusätzliche Informationen: Sonstige Anforderungen Vorbehalten bleiben die Beschaffungsreife des Projektes sowie die Verfügbarkeit der Kredite.

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

2.1.6. Ausschlussgründe

Quellen der Ausschlussgründe: Auftragsunterlagen

5. Los

5.1. Los: LOT-0000

Titel: Integrierter UHV-Cluster für gepulste Laserdeposition (PLD) und Sputterdeposition von Dünnschichten

Beschreibung: Das Laboratorium für Anorganische Chemie der ETH Zürich plant die Beschaffung eines integrierten UHV-Clusters für gepulste Laserdeposition (PLD) und Sputterdeposition von Heterostrukturen aus Oxid- und Metallschichten. Das System soll die Materialsynthese auf Oxidsubstraten mit einer Fläche von bis zu 10 x 10 mm² ermöglichen. Es soll aus einer PLD-Kammer, einer Sputterkammer, einer zentralen UHV-Transferkammer und einer Schleusenkammer für den Austausch von Proben und PLD-Targets bestehen, ohne die Prozesskammern zu belüften. Alle Kammern müssen Basisdrücke unter 1 x 10⁻⁷ mbar aufweisen. Die PLD-Kammer muss mit einem KrF-Excimerlaser und in-situ Hochdruck-RHEED ausgestattet sein und für routinemässiges epitaktisches Oxidwachstum bei hohen Temperaturen um 1100 °C geeignet sein. Die Sputterkammer muss DC- und RF-Magnetron Sputtern von Metall- und Oxidschichten ermöglichen, einschliesslich reaktivem Sputtern in Ar/O₂-Atmosphären, mit Substratheizung bis mindestens 700 °C unter Verwendung eines Probenträgersystems, das mit der PLD-Kammer kompatibel ist. Das System muss den Probentransfer zu einem externen UHV-Transferkoffer ermöglichen und UHV-kompatible Ports für die zukünftige Erweiterung des Clusters vorsehen. Für weitere Details siehe Spezifikationsdokument.

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Lieferleistungen

Haupteinstufung (cpv): 38000000 Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)

Optionen:

Beschreibung der Optionen: gemäss Ausschreibungsunterlagen

5.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Zürich ETH Hönggerberg

Postleitzahl: 8093

Land, Gliederung (NUTS): Zürich (CH040)

Land: Schweiz

5.1.3. Geschätzte Dauer

Andere Laufzeit: Unbekannt

5.1.4. Verlängerung

Maximale Verlängerungen: 0

5.1.6. Allgemeine Informationen

Vorbehaltene Teilnahme:

Teilnahme ist nicht vorbehalten.

Die Namen und beruflichen Qualifikationen des zur Auftragsausführung eingesetzten

Personals sind anzugeben: Noch nicht bekannt

Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

5.1.9. Eignungskriterien

Quellen der Auswahlkriterien: Auftragsunterlagen

5.1.10. Zuschlagskriterien

Kriterium:

Art: Qualität

Beschreibung: Zuschlagskriterien

Beschreibung der anzuwendenden Methode, wenn die Gewichtung nicht durch Kriterien ausgedrückt werden kann: Die Zuschlagskriterien sind in den Dokumenten definiert.

5.1.11. Auftragsunterlagen

Zugang zu bestimmten Auftragsunterlagen ist beschränkt

Informationen über zugangsbeschränkte Dokumente einsehbar unter: [https://www.simap.ch/de/redirect?](https://www.simap.ch/de/redirect?context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwslm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQ)

[context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwslm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQ](https://www.simap.ch/de/redirect?context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwslm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQ)

Ad-hoc-Kommunikationskanal:

Name: Simap.ch

5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe

Bedingungen für die Einreichung:

Elektronische Einreichung: Zulässig

Adresse für die Einreichung: [https://www.simap.ch/de/redirect?](https://www.simap.ch/de/redirect?context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwslm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQ)

[context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwslm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQ](https://www.simap.ch/de/redirect?context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwslm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQ)

Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Englisch

Elektronischer Katalog: Nicht zulässig

Varianten: Zulässig

Die Bieter können mehrere Angebote einreichen: Nicht zulässig

Frist für den Eingang der Angebote: 12/07/2026 18:00:00 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit

Dauer, während der das Angebot gültig bleiben muss: 180 Tage

Auftragsbedingungen:

Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte

Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Noch nicht bekannt

Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Weitere Angaben in der offiziellen Publikation auf simap.ch

Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich

Aufträge werden elektronisch erteilt: nein

Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja

Finanzielle Vereinbarung: Weitere Angaben in der offiziellen Publikation auf simap.ch

5.1.15. Techniken

Rahmenvereinbarung:

Keine Rahmenvereinbarung

Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Bundesverwaltungsgericht

Informationen über die Überprüfungsfristen: Rechtsmittelbelehrung Gegen diese Verfügung kann gemäss Art. 56 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB) innert 20 Tagen seit Eröffnung schriftlich Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, erhoben werden. Die Beschwerde ist im Doppel einzureichen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel sowie die Unterschrift der beschwerdeführenden Person oder ihrer Vertretung zu enthalten. Eine Kopie der vorliegenden Verfügung und vorhandene Beweismittel sind beizulegen. Die Bestimmungen des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG) über den Fristenstillstand finden gemäss Art. 56 Abs. 2 BöB keine Anwendung.

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: ETH Zürich - Abt. Procurement & Export Services

8. Organisationen

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: ETH Zürich - Abt. Procurement & Export Services

Registrierungsnummer: 894f1883-0c3c-42a8-b58c-ef232d567cf1

Postanschrift: Binzmühlestrasse 130

Stadt: Zürich

Postleitzahl: 8092

Land, Gliederung (NUTS): Zürich (CH040)

Land: Schweiz

E-Mail: publictender@ethz.ch

Telefon: +41446321111

Internetadresse: <https://www.ethz.ch>

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Bundesverwaltungsgericht

Registrierungsnummer: BVGER

Postanschrift: Postfach

Stadt: St. Gallen

Postleitzahl: 9023

Land, Gliederung (NUTS): St. Gallen (CH055)

Land: Schweiz

E-Mail: info@bvger.admin.ch

Telefon: +41584652626

Internetadresse: <https://www.bvger.ch>

Rollen dieser Organisation:

Überprüfungsstelle

8.1. ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: Simap.ch

Registrierungsnummer: CH001

Postanschrift: Holzikofenweg 36

Stadt: Bern
Postleitzahl: 3003
Land, Gliederung (NUTS): Bern / Berne (CH021)
Land: Schweiz
E-Mail: support@simap.ch
Telefon: +41584646388
Internetadresse: <https://www.simap.ch>
Rollen dieser Organisation:
TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 757d032f-7cb1-4bbe-8b0d-3d39d0a37fc9 - 01
Formulartyp: Wettbewerb
Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Unterart der Bekanntmachung: 16
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 01/06/2026 02:25:55 (UTC+02:00)
Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch, Französisch, Englisch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 377893-2026
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 104/2026
Datum der Veröffentlichung: 02/06/2026